

Programme de la formation " Fondamentaux et Perfectionnement en MEB et Microanalyses"

	DIMANCHE 2 juillet 2017	LUNDI 3 juillet 2017	MARDI 4 juillet 2017	MERCREDI 5 juillet 2017	JEUDI 6 juillet 2017	VENREDI 7 juillet 2017
08h30-09h10		<i>discours d'accueil, informations générales</i>	Les détecteurs d'électrons	Analyse d'échantillons stratifiés	Analyse EBSD	Contrôle, maintenance du MEB de l'EDS
09h15-09h55		Interactions électrons- matière	Formation et optimisation d'image	MEB à pression contrôlée	Microscopie double colonne MEB-FIB	TD au choix
10h00-10h40		Emission électronique et photonique	EDS et traitement des spectres	<i>Pause (10h-10h30)</i>	<i>Pause (10h-10h30)</i>	
<i>10h40-11h10</i>		<i>pause</i>	<i>pause</i>	Imagerie et μ .analyse à basse tension	Applications aux échantillons bio	
11h15-11h55		Les canons à électrons	WDS et traitement des spectres	Notions de traitement statistique	Préparation des échantillons	TD au choix
12h00-12h40		Les colonnes électroniques	Analyse X quantitative	Analyse d'image MEB	Les accessoires en MEB	
<i>12h45-14h15</i>		<i>repas</i>	<i>repas</i>	<i>repas</i>	<i>repas</i>	<i>repas</i>
14h15-15h45		Accueil	TD Niv 1: MEB instrument	TD Niv 1: MEB image	<i>sortie culturelle</i>	TD Niv 1: EDS quali et quanti
	TD Niv 2*		TD Niv 2*	TD Niv 2*		Remise attestation de présence
<i>15h45-16h30</i>	<i>pause</i>		<i>pause</i>	<i>pause</i>		Clôture école
16h30-18h00	TD Niv 1: MEB instrument		TD Niv 1: MEB image	TD Niv 1: EDS carto spectrale		
	TD Niv 2*		TD Niv 2*	TD Niv 2*		
18h00-19h00	démo constructeurs personnalisés possibles		démo constructeurs personnalisés possibles	démo constructeurs personnalisés possibles		
<i>19h15</i>	<i>Réception mairie</i>					

* 6 TD niveau 2 en alternance: MEB-PC, WDS, MEB-FEG, FIB, EDS quantitative avec témoins, EBSD